ユニテクセンター

〒346-022 埼玉県久喜市下早見1869-1



保有分析機器

マイクロスコープ 分光高度計 プラズマ発光分析装置 走査型電子顕微鏡(EDS) 蛍光X線分析装置 研磨器 カロテスト器 精密天秤 レーザーマイクロ

-技術発展への取組み-

めっき液及びめっき設備は、作業過程で変化していきます。 その変化が著しくなると、良質なめっき施工が不可能になってしまいます。 その様な状況に陥らない為にも、管理体制を強化しなければなりません。 自社では高品質めっきを維持すべく、多様な分析機器を駆使し、更なる技術革新に尽力 していきます。

マイクロスコープ



最大1000倍率まで拡大可能です。めっき皮膜表面の状態を鮮明に確認することが出来ます。また、3D画像も作成可能となります。

プラズマ発光分析装置 (ICP)



溶液中の元素(主に金属 元素)濃度を追究すること が可能です。

金属不純物をppmで求めることも行え、めっき液及び前処理液中の金属濃度確認に用いられます。

EDS機能付き電子顕微鏡



2次電子を用い、電子的 に皮膜の結晶構造の把握を することが可能です。

また、皮膜中の保有元素も 確認することが可能なため 、皮膜の構成元素が目視で 見ることが出来ます。

高精度蛍光X線膜厚計



測定物にX線を照射。めっき皮膜から放射されるX線量を測定し、膜厚を導きます。自社は、合計4台の蛍光X線装置を完備しています。各工場に完備されている為、迅速対応を可能としています。